





Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Festkörperelektronik Professur für Beschichtungstechnologien

Lehrankündigung

Modul Plasmatechnik, 7 ECTS

Grundlagen, Verfahren und Anwendungen in Sensorik, Optik, Elektronik und organische Optoelektronik

Im Wintersemester 2024/2025

Vorlesung am **Donnerstag 4.+5. DS (13:00-16:20)** im **VMB/302** Übung am **Freitag 5. DS (14:50-16:20)** im **BAR/0E85/U**

OPAL

Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Materialwissenschaft, Physik, Chemie und an andere technisch interessierte Studierende.



Inhalte:

1. Grundlagen

Vakuumerzeugung und -messung, Physik des Niederdruckplasmas, Erzeugung technischer Plasmen, Wechselwirkung von Ionen mit Festkörperoberflächen

2. Technik und Verfahren

Industrielle Plasmaquellen (Dioden- und Magnetronsputtern, Hohlkatoden, Mikrowellen), Industrielle Plasmaverfahren (reaktives Sputtern, Puls-Magnetron-Sputtern, plasmagestützte Hochratebedampfung, PECVD), Plasma-Anlagenbau

3. Anwendungen

Beschichtungen in den Gebieten: Elektronik, Optik, Piezoelektrika, Displays, Solar, Verpackung, Werkzeuge; Beschichtung unterschiedlichster Substrate: Glas, Metall, Silizium, Kunststoff, Kunststofffolien; Oberflächenbehandlung von organischen und anorganischen Substraten; großflächige OLED/OPV: Systemintegration und Anwendungen Organische Optoelektronik (Mikrodisplays und Sensoren)

4. Praktikum: Besuch der Labore des Fraunhofer FEP

Kurssprache: Englisch

Verantwortlich: Prof. Elizabeth von Hauff, Dr. Agnė Žukauskaitė (IFE)

Lehrende: Prof. E. von Hauff, Dr. A. Žukauskaitė, Dr. S. Saager, Dr. G. Gotzmann, F.H. Rögner